# シンクロトロン光を使った 顕微赤外・テラヘルツ分光法の開発



# 木 村 真 一\*

# Development of infrared and terahertz micro-spectroscopy using synchrotron radiation

Key Words: synchrotron radiation, infrared, terahertz, micro-spectroscopy

## 1. はじめに

赤外およびテラヘルツ(遠赤外)領域の分光は, 格子・分子振動や電子励起,超伝導のクーパー対生 成によるギャップなどの物質の素励起が直接観測で きるエネルギー領域であり,物性物理学や分析化学・ 生命科学などの広い分野で欠かせない実験手法であ る。また,数10μm程度の空間領域の分光やマッ ピングも顕微赤外分光法として知られており,標準 的な実験手法として確立している。しかしながら, 市販の顕微赤外分光装置で使われている黒体光源(熱 光源)は,輝度が高くないために,十分な強度で顕 微分光を行うためには,空間分解能を光の限界(回 折限界)まで高くすることは難しい。

一方で,顕微赤外分光は,エネルギーが50meV より高い(波長が25 µmより短い)中赤外と近赤 外が主であり,50meVより低い(20 µmより長い) テラヘルツ領域ではほとんど用いられていない。そ の理由は,顕微赤外分光法でターゲットとしている 軽い分子の振動モードの多くが中・近赤外に存在す るためである。また,中・近赤外分光で用いられて いる黒体光源は,テラヘルツ領域では強度が低いた めに,顕微分光には使うことが難しい状況にある。 しかしながら,テラヘルツ領域は,電磁波のエネル ギーが室温のエネルギーと同程度であるため,物性 の起源である超伝導ギャップや重い電子系の起源で



\* Shin-ichi KIMURA

1966年2月生 現在、大阪大学大学院生命機能研究科 光物性研究室 教授 理学博士 物性物理学,放射光科学 TEL:06-6879-4600 FAX:06-6879-4601 E-mail:kimura@fbs.osaka-u.ac.jp ある c-f 混成ギャップなどの電子構造, さらに, タ ンパク質などの生体物質の機能性の元になる熱ゆら ぎや大きな分子全体の振動モードなどが観察できる ため,極めて有益な情報が得られる。すなわち, 微 小領域での電子構造や格子・分子振動, 熱ゆらぎな どを明確に観察することは, それらを理解する上で 重要な役割を果たすことが期待できる。

以上のような市販の顕微赤外分光装置の困難を克 服するために,我々はシンクロトロン(SR)光を 使うことで,顕微赤外・テラヘルツ分光を行ってい る。SR光により,空間分解能を回折限界まで高め ることができるばかりでなく,テラヘルツ領域での 顕微分光が可能になる。このようなアイディアのも とで,我々が自然科学研究機構分子科学研究所のシ ンクロトロン光施設UVSORに建設した,赤外・テ ラヘルツビームラインの光学系と顕微赤外装置・顕 微テラヘルツ装置について紹介する。

#### 2. 赤外・テラヘルツビームラインの光学系

SR光は、電子が光速に近い速度で外場を受けな がら運動する場合に、電子の持っているエネルギー が振り落とされることによって発生することは知ら れている。その単位発散角あたりの放射スペクトル 強度は、 $d^2P(\omega)/d\omega d\Omega$ は、式(1)で与えられる[1]。 ここで e は素電荷、 $\epsilon_0$ は真空の誘電率、c は光速、  $\rho$  は電子軌道の半径、 $\gamma$  は電子の静止エネルギー に対する比エネルギー、 $\theta$  は放射方向からの角度、  $K_{2/3}(\xi), K_{1/3}(\xi)$  は変形ベッセル関数である。この 式から得られる、UVSORの偏向電磁石部からの SR の、軌道面に垂直方向の発散角を図 1a に示す。こ こでは、光エネルギーが 100 eV の場合と 0.1 eV の 場合について示した。この図から、エネルギー 100 eV の光は、ほぼ 0 mrad の軌道面上に集まっている が、0.1 eV の光は、軌道面の強度に比べて、そこか

$$\frac{d^2 P(\omega)}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{12\pi^3 \varepsilon_0 c} \left(\frac{\omega \rho}{c}\right)^2 \left(\frac{1}{\gamma} + \theta^2\right) \left\{K_{2/3}^2(\xi) + \frac{\gamma^2 \theta^2}{1 + \gamma^2 \theta^2} K_{1/3}^2(\xi)\right\}$$
(1)

ら10 mrad 以上離れた角度に強度があることがわか る。さらに、0.1 eVの光の強度は100 eVのものと 比較して数10分の1程度であることから、0.1 eV の光を大きな強度で得るためには、縦方向に広がっ た大きな発散角を取り込む必要がある。しかしなが ら、加速器の電子ビームが通る真空槽による制限の ため、取り込み角は±50 mrad 程度が限界である。 さらに高い強度を得ようとすると、水平方向の取り 込み角を増やす必要がある。

水平方向の電子軌道の微小部分からの発散角は, 式(1)で与えられるものになるが,偏向電磁石から の放射の場合,磁場によって電子が受けたローレン ツ力が作る円軌道が重要になる。縦方向と同様に, 大きな発散角でSRを取り込もうとすると,発光点 は電子の円軌道になる。このことは,偏向電磁石か らのSRは,理想的な「点光源」ではなく「線光源」 であることを意味する。この光を,球面鏡やトロイ ダル鏡などの点光源で理想的な光学系を用いると, その「集光点」も「集光線」になってしまい,SR の高い輝度を損ねてしまう。

そこで、非球面・非対称の集光鏡である「マジッ クミラー」が1976年に考案された[2]。この鏡は円 弧から接線方向に発する SR を1点に集光するとい う近似が入らない理想的な鏡の形状を持っている。 しかしながら、当時は、電子の運動する軌道面内だ け定式化(つまり、軌道面に対して鉛直方向の形状 がない2次元の関数)されており、上で説明した軌 道面に垂直な方向に発散した光の集光に関しては全 く議論されていなかった。そのために、これまでに 現実の SR 光の集光に用いられることはこれまで全 くなかった。

偏向電磁石からの SR を集光するのには,理想的 には図 1b に示されるように,円軌道からの発光を すべて1点に集める必要がある。そこで我々は,こ



図1 (a) シンクロトロン光の軌道面に垂直方向の発散角の光エネルギー依存性。UVSORのパラメータで計算した。 (b) 理想的な偏向電磁石光源の集光。 (c) マジックミラーの形状の概念図。

のマジックミラーを軌道面に垂直方向も集光するように拡張した形状(三次元マジックミラー,図1c) を考案した。具体的には,水平方向はマジックミラ ーの形状,垂直方向は発光点と集光点,およびミラ ーの位置と入射角から決まる集光条件から出した球 面の形状とした。具体的な式は,参考文献3を参考 にしていただきたい。

この光学系は、最初に1999年にSPring-8の赤外 物性ビームライン(BL43IR)に導入した[4]。その 理由は、極めて大きな放射光リングであるSPring-8 は偏向電磁石内の電子の軌道半径は約40mであり、 水平方向の取込角を36mradとした場合には、約 1.44mの円弧からの発光になる。このような光は 主に点光源の集光に用いられる球面鏡やトロイダル 鏡ではうまく集光できず、SRの持つ高輝度性が活 かすことができない。そこで三次元マジックミラー を導入することで集光に成功し、現在では、高輝度 性を活かした顕微分光などに利用されている。

しかしながら,近赤外からテラヘルツまでカバー した広いエネルギー領域の分光を行うには,比較的 小さいシンクロトロン光源の方が有利である。そこ で,三次元マジックミラーを,SPring-8より小さい 光源加速器である UVSOR に導入した [5]。具体的 には,UVSORには,世界で最初に共同利用のため に建設された赤外・遠赤外ビームラインがあり,そ れを改造する事になった際に,三次元マジックミラ ーを導入して世界でも最も大きな取り込み角を実現 した。この赤外・テラヘルツビームライン(BL6B) は順次拡張され,現在では,回折限界の赤外イメー ジングとテラヘルツ顕微分光に利用されている。

BL6Bの全体の写真および出射部の光学系を,図2a, 2bに示す。SR光を取り出す最初のミラーがマジッ クミラーである。ここで導入された三次元マジック ミラーの大きさは水平方向300mm,垂直方向100 mmで,215mrad(水平方向)×90mrad(垂直方向) の取込角を実現している。

このようにして取り出された SR 光は、図 2b で 示されたように、2枚の平面鏡 (M1, M2) で光軸の 位置及び方向を調整されて第一焦点 (image focus) 位置に導かれる。この第一焦点位置での光の大きさ と発散角をかけたものがビームラインの光のエミッ タンスである。図3に、BL6Bの第一焦点での光の 大きさを光線追跡法で計算した結果と、実際に測定 して得られた大きさを示す。計算は0.1 eVの光に 対して行い, 半幅 (σ) が1mm (水平方向) × 2 mm (垂直方向)の大きさになっている。これに対し、 HgCdTe (MCT) 検出器を用いて 0.05 ~ 1 eV の範 囲の光を観測した結果,半径約1.2mmの円形であ ることがわかった。この結果は、3次元マジックミ ラーによってほぼ理想的に SR 光が集光されている ことを示している。また, 第一焦点はマジックミラ ーから2.5mの位置にあり、第一焦点からマジック ミラーへの水平方向の見込み角  $(2\sigma_x)$  は約86 mrad なので、0.1 eVの光に対する横方向の光のエミッタ ンス  $(\sigma_{\mathbf{x}} \times \sigma_{\mathbf{x}})$  は 52  $\mu$ m rad になる。一方で,縦方 向は、図 1a の発散角 ( $\sigma_v$ ' ~ 12 mrad) と発光点の 中心からマジックミラーの距離(約1m)とマジッ クミラーから第一焦点までの距離(約2.5m)を考



図2 (a) UVSOR の赤外・テラヘルツビームライン BL6B の全体図。
(b) 光を取り出す出射部。



図3 BL6Bの焦点(図2bのimage focus)における ray trace によるビームサイズの計算値 (a) と実際の測定値 (b)。 計算は 0.1eV のエネルギーを仮定し,測定は,0.05 ~ 0.5eV を積分した結果になっている。

慮することにより,光のエミッタンス( $\sigma_y \times \sigma_y$ ) は5.4  $\mu$ m rad となる。通常使われている赤外分光 計の光源のエミッタンスは $\sigma_{x, y} \times \sigma_{x, y}' = 200 \sim$ 1000  $\mu$ m rad 程度であり,SR光が極めて低いエミ ッタンスを持った光であることがわかる。

このような低いエミッタンス性は高い輝度の光を 作る。実際に,BL6Bの輝度は図4に示すように, 従来の光源に比べて桁違いに高い。具体的には,中 赤外域(0.1~1eV)付近では1~2桁程度高いだ けだが,遠赤外・テラヘルツ領域(0.1eV以下)で は2~4桁高い。この性能は,微小領域に集光する



図4 BL6Bの輝度の測定値(実線)と計算値(破線)。 1400Kを仮定した熱光源(黒体輻射光源)も比較 のため示した。

必要がある顕微分光に有利である。

図2aには、現在のビームラインの各実験装置(エ ンドステーション)の配置図も示してある。エンド ステーションは、顕微赤外分光イメージング、顕微 テラヘルツ分光、反射吸収分光の合計3つの装置が ある。これらのうち、反射吸収分光装置は、通常の 分光を行うための標準的な実験装置であるため、 SR光の特徴を活かした顕微赤外分光イメージング と顕微テラヘルツ分光の2つについて、以下で紹介 する。

#### 3. 顕微赤外分光イメージングエンドステーション

図 5a に BL6B に設置した顕微赤外分光イメージ ング装置(日本分光社製 FT/IR 6100 + IRT 7000) の写真を示す。この装置は,標準でセラミック光源 (熱光源)とハロゲンランプが備えられており,ま た赤外顕微の検出器には,単素子と16素子が一列 に並んだ MCT が切り替えられるようになっている。 この装置に,赤外 SR 光が導入できるポートを取り 付け,高輝度赤外 SR を光源とした顕微赤外分光イ メージングを可能にした。

例えば,USAFのテストパターンのSR光と熱光 源での比較を図5bに示す。一見してわかるように, SRを光源とした場合には極めて高いコントラスト が得られている。実際に,各波数でのテストパター ンのイメージを取り,そのコントラストから空間分 解能を見積もったグラフを図5cに示す。比較のた めに,各波数に対応する波長もあわせて示している。 この図から,3000 cm<sup>-1</sup>以下では,波長程度の空間 分解能になっていることがわかる。熱光源を使った



図5 (a) BL6Bの赤外顕微分光イメージングエンドステーションの写真。
(b) SR光と熱光源で測定した波数 4000cm<sup>-1</sup>でのテストパターンのイメージ。
(c) 各波数での空間分解能の実測値と波長との比較。

場合の空間分解能は,全領域で数10µm 程度にな るため,SR光の高い輝度の特性が発揮されている。 空間分解能だけ見れば,この方法では回折限界を超 えることはできないため,近接場顕微鏡には敵わな い。しかしながら,試料回りに大きな空間が必要で 波長程度の空間分解能が必要なときにSRの優位性 が発揮される。

#### 4. 顕微テラヘルツエンドステーション

テラヘルツ SR は高輝度性に優れており,顕微分 光に適している。顕微分光といっても,回折限界の 制限によって,その空間分解能は波長程度になる。 つまり,10 meV の光(周波数~3 THz,波長~120  $\mu$ m)では約100  $\mu$ m が限界である。実際に,SR 光 を導入してテラヘルツ顕微鏡の試料位置での波数 100 cm<sup>-1</sup>でのビームサイズを測定したものを図 6a に示すが,焦点位置での光の大きさは,対応する波 長の100  $\mu$ m 程度になっていることがわかる。

しかしながら、この空間分解能ではナノメートル スケールの量子現象などは到底観察できない。それ でも、これまでのテラヘルツ分光では不可能だった サブミリメートルサイズの物理現象、例えばダイヤ モンドアンビルセル(DAC)などの高圧セル内で 実現できる超高圧下の相転移に伴う光学スペクトル の変化などは十分に観測できる。

このような目的のために、我々はテラヘルツ顕微 分光装置(図 6b)を設計・製作し、ビームライン に設置した(図2a)。この顕微分光の主な目的は, 固体試料の低温・高圧下での分光なので、試料冷却 のためのクライオスタットを用いる必要がある。冷 却による試料位置の変化を最小限にするために、ク ライオスタットが収縮する方向を重力の働く方向に なるようにクライオスタットを垂直に立てることに した。この場合には, 試料が水平方向に向くため, テラヘルツ顕微分光装置ではシュワルツシルド鏡を 水平方向に設置した。また,市販の赤外顕微鏡のシ ュワルツシルド鏡の直径が約50mmであるのに対し, ここで導入したシュワルツシルド鏡は、テラヘルツ 光の回折による強度の減少を極力減らすために、約 140 mm のものを採用している。シュワルツシルド 鏡間の Working distance は 110 mm であり, DAC を取り付けたクライオスタットも十分設置できる。

この装置を使って、低温・高圧下のテラヘルツ反 射スペクトルや、極低温での微小試料のテラヘルツ 分光などを行っているが、詳細は他誌に譲ることに したい [6-8]。





図6 (a) BL6B に設置したテラヘルツ顕微分光エンドステーションの写真と焦点位置での波数100cm<sup>-1</sup>の空間分布。 (b) テラヘルツ顕微分光装置内部の構成。

## 5. まとめ

ここでは、著者が中心になって開発してきた赤外・ テラヘルツシンクロトロン光ビームラインと、それ を用いた回折限界分解能の顕微分光法について解説 してきた。最近では、赤外SR光を用いた顕微分光 法は世界的に標準のツールになってきており、細胞 薄片などの生体物質や固体の微小試料、化学反応の 経時観測などで威力を発揮している。国内では、し かしながら、海外に比べてあまり活用されていない のが現実である。本稿がきっかけになって、これま でにないまったく新しい赤外・テラヘルツ顕微分光 法が生まれればと考えている。

#### 謝辞

本稿をまとめるにあたり,ご推薦いただいた豊田 岐聡教授には,このような貴重な機会をいただき感 謝いたします。また,赤外放射光の分野にお導きい ただいた難波孝夫・神戸大学名誉教授をはじめとし て,ビームライン建設などで,一緒に悩み,汗を流 した参考文献の共著者の方々には,改めて感謝した いと思います。

#### 参考文献

- J. D. Jackson, Classical Electrodynamics 3<sup>rd</sup> Ed., (Wiley, 1998).
- [2] R. Lopez-Delgado, H. Szwarc, Opt. Commun. 19, 286 (1976).
- [3] S. Kimura, Frontiers in Optical Methods; Nanocharacterization and Coherent Control (K. Shudo, I. Katayama, S. Ohno Eds., Springer Series in Optical Sciences, Vol. 180, 2014).
- [4] S. Kimura, H. Kimura, T. Takahashi, K. Fukui, Y. Kondo, Y. Yoshimatsu, T. Moriwaki, T. Nanba, T. Ishikawa, Nucl. Instrum. Meth. A 467-468, 437 (2001).
- [5] S. Kimura, E. Nakamura, T. Nishi, Y. Sakurai, K. Hayashi, J. Yamazaki, M. Katoh Infrared Phys. Tech. 49, 147 (2006).
- [6] T. Iizuka, T. Mizuno, B. H. Min, Y. S. Kwon, S. Kimura, J. Phys. Soc. Jpn. 81, 043703 (2012).
- [7] S. Kimura, H. Okamura, J. Phys. Soc. Jpn. 82, 021004 (2013).
- [8] 木村真一, 固体物理 47, 365 (2012).